

令和3年4月15日

教職員各位

研究設備センター
基盤研究設備部門長 平野 誉

基盤研究設備部門の設備使用について

基盤研究設備部門では昨年度を除いて毎年4月末から6月にかけて主要設備の使用法講習会を開催してまいりました。今年度は昨今の東京都の感染状況を鑑みまして「複数人を対象とした対面での講習会」の開催を見送っております。

各研究室におかれまして、使用法に不慣れな設備がありましたら、下記までご連絡ください。連絡をいただいた研究室の代表1名に対して、感染対策に留意しながら「使用法の教授」を行っていただくよう、センターから設備管理者の方々に依頼いたします。

連絡先：研究設備センター 桑原大介 kuwahara@uec.ac.jp